# 解説 単一ショットバーストイメージング法 STAMP の原理と応用

# Principles and Applications of Single Shot Burst Imaging: Sequentially Timed All-optical Mapping Photography (STAMP)

神 成 文 彦 KANNARI Fumihiko 慶應義塾大学理工学部電気情報工学科 (原稿受付: 2020年6月8日)

瞬時周波数が時間と共に線形に変化した光パルスを用い瞬時周波数を時刻と対応させることで,高速現象を 能動的に単一ショットで時間分解イメージ計測することが可能となる.ただしその実現には,異なる瞬時周波数 のイメージを単一ショットで撮像できる分光イメージング法が不可欠である.この原理を,フェムト秒レーザー パルスを用いて実現したのが STAMP (Sequentially Timed All-optical Mapping Photography)である.サブピコ 秒の時間分解能で20以上のバーストフレーム画像を単一ショットで取得できる STAMP の原理,時間分解能,計 測時間窓などについて解説する.

#### Keywords:

ultrafast burst imaging, femtosecond laser, chirped laser pulse, hyper spectral imaging

### 1. はじめに

レーザーの短パルス化とともに、再現性の高い現象であ れば、時間遅延を走査したポンプ・プローブ法を用いた繰 り返し計測により、レーザーパルス幅を時間分解能とした 超高速光学計測が可能となり広く利用されてきた. 短パル スレーザーを用いた類似法として、自己相関計測法[1,2], 光Kerrゲート法[3,4],和周波発生ゲート法[5]などがある が、再現性に乏しい現象に対しては、これらの繰り返し計 測手法は適応できない.一方,光電子ストリーク管を用い たストリークカメラは、これまで唯一汎用的な単一現象計 測手法であった.ストリークカメラで取得できるのは空間 的一次元情報ではあるが、10<sup>12</sup> fps の高速撮影が実現され ている.近年,時間域圧縮センシング手法を用いた CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) カメラも研 究されているがその撮像速度は 10<sup>8</sup> fps である[6].通常の ストリークカメラ撮影において、空間的に直交するもう一 軸をエンコードして二次元イメージ取得する手法も考案さ れ実用されてきた[7-9]. 最近では,符号化多重でもう一 軸をエンコードして記録し、像再構築を行うことで 10<sup>11</sup> fps の高速二次元イメージングを行う手法 CUP (Compressed Ultrafast Photography)が注目されている[10,11]. ただし、CUP 等の圧縮センシング法は、計測時間窓を非常 に広くできる利点の一方で、像再構築における両義性が高 く空間分解能は犠牲となってしまう.

ポンプ・プローブ計測で高い時間分解能を実現する際に は、パルス幅が最短となるフーリエ変換限界(FTL: Fourier Transform Limited)パルスと呼ばれるパルスの周 波数モード間の相対位相が一定か周波数に対して1次関数 のパルスを用いる.しかし,パルス内で瞬時周波数が時間 に対して線形に変化するような光パルス(線形周波数 チャープ光パルス)を用いると,瞬時周波数と時刻を1対 1で対応させることができるので,フーリエ光学に基づい た周波数域での光操作により今までにはない超高速計測法 が可能になる.もちろんレーザーパルスはFTLパルス幅よ りも長くなるが,もはやそれらの方法においては時間分解 能とパルス幅は対応しない.チャープパルスを用い「時 間-周波数」の対応関係を用いたシングルショットイメー ジングは断層計測[12]や一次元計測[13]に用いられた報告 例は存在したが,二次元超高速イメージング法に応用する 際の鍵となるのは,異なる周波数のイメージを同時に何枚 も取得できる分光メージング法にあった.

2014年,筆者等は単一のレーザーパルスをCCDカメラの フレーム上に時空間的に6分割するシステムを構築し,プ ローブ光である周波数チャープパルスの各周波数に時間を 対応させることで単一ショットのフェムト秒バーストイ メージ撮影法STAMP (Sequentially Timed All-optical Mapping Photography)を開発した[14]. この手法で最大  $4.4 \times 10^{12}$  fps に相当する超高速連写撮影が実現された.

本解説では、周波数チャープについて説明し、時間域と 空間域の双対性を概説した上で、STAMPの基本原理と性 能を定義する要素を解説し、これまで STAMP で用いられ ている3種類の分光イメージング法とその計測例を紹介す る.

Faculty of Science and Technology, Keio University, Yokohama, KANAGAWA 223-8522

author's e-mai: kannari@elec.keio.ac.jp

# 2. 周波数チャープを利用した時間-周波数変換 2.1 周波数チャープ

自由空間を伝搬するレーザーパルスの光電界E(t)は、時間変化する振幅 A(t)、位相 $\theta(t)$ を用いて次のように表現できる.

$$E(t) = A(t)e^{j\theta(t)}$$
(2.1)

 $|A(t)|^2$ は光強度の時間変化を表し、観測されるパルスの時間波形における包絡線に対応する.また位相 $\theta(t)$ は、中心角周波数 $\omega_0$ 、時間依存位相 $\varphi(t)$ 、絶対位相 $\theta_0$ を用いて

$$\theta(t) = \varphi(t) - \omega_0 t + \theta_0 \tag{2.2}$$

と表される.これらのパラメータを変化させることで,超 短光パルスは様々な振幅・位相特性を示すことができる.  $\theta(t)$ の時間による1階微分は瞬時周波数を意味する.

フェムト秒レーザーパルスのような広帯域パルスでは, 時間領域における記述に加え,周波数領域での記述が分散 特性の理解やレーザーパルスの制御という観点から重要に なる.レーザーパルスの光電界*E*(*t*)をフーリエ周波数成分 の合成として表すと,フーリエ変換の関係から

$$E(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{-j\omega t} d\omega$$
(2.3)

となる.  $F(\omega)$ は、フーリエ周波数成分であり、スペクトル 振幅 $B(\omega)$ 、スペクトル位相 $\phi(\omega)$ を用いて次のように表現 される.

$$F(\omega) = B(\omega) e^{-j\phi(\omega)}$$
(2.4)

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}E(t)e^{j\omega t}\,\mathrm{d}t\tag{2.5}$$

上式からわかるように、振幅A(t)、位相 $\theta(t)$ の組が決まれ ば、スペクトル振幅 $B(\omega)$ 、スペクトル位相 $\phi(\omega)$ の組も一 意的に定まり、逆も同様である.ここで、 $\phi(\omega)$ の周波数に よる1階微分は群遅延を表す、スペクトル位相が一定ある いは1次関数のときには、レーザーパルスの群遅延が全周 波数成分にわたり一定となり(モード同期)、パルスの時 間幅が最も短くなる.これがFTLパルスである.このと き、パルス幅 $\Delta t$ と周波数幅 $\Delta \nu$  (=  $\Delta \omega/2\pi$ )の間に不確定性 関係の等号が成立する.

また、スペクトル位相φ(ω)を何らかの方法で変調(整形) することにより、パルスの時間波形を変化させることが可 能となることも容易に予想できる.これは、フェムト秒 レーザーパルスのフーリエ波形整形技術として汎用的に利 用されている.

次に、レーザーパルスのスペクトル位相φ(ω)が周波数 に依存して変化する、群遅延分散効果について説明する. たとえば光パルスを光ファイバーに通すと、光の周波数変 化に伴い物質の屈折率が変化する材料分散と導波路の構造 に起因する構造分散によりパルスの周波数成分は異なる群 遅延を受ける.スペクトル位相φ(ω)を中心角周波数ω<sub>0</sub> の周りでテイラー展開すると以下のようになる.

$$\phi(\omega) = \phi_0 + \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\omega}(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}\omega^2}(\omega - \omega_0)^2 + \frac{1}{6}\frac{\mathrm{d}^3\phi}{\mathrm{d}\omega^3}(\omega - \omega_0)^3 + \cdots$$
(2.7)

この式の右辺第2項の係数 d $\phi$ /d $\omega$  は、レーザーパルスに群 遅延を与え1次分散と呼ばれる。右辺第3項の d<sup>2</sup> $\phi$ /d $\omega$ <sup>2</sup> は、群遅延分散 (GDD:Group Delay Dispersion) または2次 分散と呼ばれ、レーザーパルスの波形を変化させる。右辺 第4項以降の係数は、高次の分散と呼ばれ、パルス幅が短 くなると影響を考慮しなければならない。

ここで,2次分散がレーザーパルスの時間波形に与える 効果について考える.入射光としてガウス型のFTLパルス を仮定すると時間領域におけるレーザーパルスの光電界 *E*<sub>in</sub>(*t*)は,次式のように表現できる.

$$E_{\rm in}(t) = A_0 e^{-\alpha t^2} e^{-j\omega_0 t}$$
(2.8)

なお, ガウス型パルスのパルス幅 (半値全幅) *Δt* とスペク トル幅 *Δ*ω (半値全幅) は次のようになる.

$$\Delta t = \sqrt{\frac{2\ln 2}{\alpha}} \tag{2.9}$$

$$\Delta\omega = \frac{4\ln 2}{\Delta t} \tag{2.10}$$

このレーザーパルスが媒質中を伝搬し、 2 次分散(群遅 延分散)  $\phi_g = d^2 \phi / d\omega^2$  が付加されるとき、出力パルスの光 電界  $E_{out}(t)$  は次式のように得られる.

$$E_{\text{out}}(t) = \frac{A_0}{2\sqrt{\alpha\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{(\omega - \omega_0)^2}{4\alpha}\right\}$$
$$\times \exp\left\{-j\frac{\phi_g}{2}(\omega - \omega_0)^2\right\} e^{-j\omega t} d\omega$$
$$\propto \exp\left\{-\frac{\alpha}{1 + 4\alpha^2 \phi_g^2} t^2\right\}$$
$$\times \exp\left\{-j\left(\frac{2\alpha^2 \phi_g}{1 + 4\alpha^2 \phi_g^2} t^2 - \omega_0 t\right)\right\} \qquad (2.11)$$

これより、2次分散によりスペクトル位相が変化し、その結果、時間領域では振幅の形状が変化してパルス幅 が広がることがわかる.出射パルスの複素振幅成分が、  $\alpha \to \alpha/(1+4\alpha^2\phi_g^2)$ と変化するのでパルス幅は、(2.11)式 より、2次分散の正負に関わらず入射パルスの $\sqrt{1+4\alpha^2\phi_g^2}$ 倍に広がる.ここで、瞬時角周波数 $\omega(t)$ は、

$$\omega(t) = -\frac{\mathrm{d}\theta(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left( \frac{2\alpha^2 \phi_g}{1 + 4\alpha^2 \phi_g^2} t^2 - \omega_0 t \right)$$

$$= \omega_0 - \frac{4\alpha^2 \phi_g}{1 + 4\alpha^2 \phi_g^2} t$$
(2.13)

Commentary

となり,正常分散 ( $\phi_g < 0$ )のとき,瞬時角周波数は時間と 共に線形に増加する正のチャープとなり,異常分散 ( $\phi_g > 0$ )の場合は,時間と共に周波数が線形に減少する負 のチャープとなることがわかる.正のチャープが乗った光 パルスでは長波長成分が短波長成分よりも速く伝搬し,負 のチャープでは逆に短波長が長波長より速く伝搬する. 図1に時間変化する線形周波数チャープパルスの概念図を 示す.



図1 正常(正)分散,異常(負)分散を受けたフーリエ変換限界 パルスの瞬時周波数変化とパルス幅の変化.

#### 3. STAMP

STAMPの原理を図2に示す. STAMPの基本概念は, 極めて単純である.フェムト秒レーザーパルスに2次分散 を与えて時間幅を伸ばし,時間に比例して変化する瞬時周 波数を時刻と対応させる(図では波長の異なるパルス列化 しているが、パルス列にすることは必須ではない).分光 イメージング手法により異なる周波数(帯)のイメージを 空間的に分割して高速性を必要としない通常のカメラで捉 えるのが STAMP である.まず,異なる周波数成分が時間 軸上に規則的に並んだ周波数チャープ光パルスで高速に変 化する被写体をプローブし、透過率(あるいは屈折率)変 化を個々の周波数成分に反映させる(以下の説明では透過 率変化による振幅変化に限って記述する. 干渉計測あるい は偏光計測を用いれば位相イメージも取得できる). ここ で重要なことは、被写体である高速現象の波長依存性は無 視しなくてはならないことである. プローブ光の周波数は 時刻としての指標に用いるので物性的分光計測はできな い、逆に、時刻としての指標を捨てれば静的な物性的分光 イメージ計測法として機能する[15].

被写体の過渡情報が埋め込まれた光パルスの周波数成分 を2次元イメージセンサ上に分光し空間的に分離すること ができれば,高速現象を異なる時刻で捉えた複数のイメー ジが単一ショットで後処理無しに直接取得できる. STAMP開発の鍵は,この単一ショット分光イメージング 法の発明であったと言っても過言ではない.連写イメージ 間のフレーム間隔および露光時間は,後述のように2次元 カメラ上への分光特性で決定される.



図 2 線形周波数チャープパルスを用いた単一ショット超高速バーストイメージング法 STAMP の原理と、初機のペリスコープアレイを用いた分光イメージングのセットアップ(参考文献[14]から許諾を得て転載).

#### 4. 分光イメージング手法

#### 4.1 幾何光学的角度分散分光イメージング

初機の STAMP においては図2のように空間分散装置 (SMD: Spatial Mapping Device)と呼ぶ回折格子とペリス コープ(反射鏡対の組み合わせ)アレイを用いた[11].周 波数チャーププローブ光は回折格子に入射し角度分散を受 け円筒鏡で光学的にフーリエ変換される.フーリエ面に置 かれた波長毎に光路差の調整されたペリスコープアレイに 入射して,空間的に6つのビームに分割される.空間的に 分割された異なる周波数帯の光は逆フーリエ変換後再度回 折格子を介して1つのイメージセンサ上で同時に計測され る(イメージセンサの露光時間は STAMP の時間分解能に 無関係である).シングルショットで撮影できる分光イ メージの枚数(連写枚数)は、ペリスコープアレイの個数 で決定される.初機では微細加工の制限から最大6枚のコ マ撮りを実現した(計測結果は6章に記載した).

#### 4.2 バンドパスフィルター分光イメージング

ペリスコープアレイに代えて連写枚数のスケーリングに 適した方法として考案したのがバンドパスフィルター (BPF: Band-Pass Filter)を用いて分光イメージを取得する 簡便な手法であり,我々はSF-STAMP (STAMP utilizing Spectral Filtering) [16]と呼んでいる.光学計測部の概念図 を図3に示す.回折光学素子 (DOE: Diffractive Optical Element)と BPF を 4 結像光学系に用いる非常に簡便な手法 である.この DOE と BPF を用いる波長フィルタリングの アイデアは,超短光パルスのシングルショット 2 次元波形 E(x,y,t)をホログラフィック干渉で計測できる STRIPED FISH (Spatially and Temporally Resolved Intensity and Phase Evaluation Device: Full Information from a Single Hologram) [17] から得たものである.

DOE と BPF による周波数成分の空間分解の概念図を 図3(a)に示す.まず, DOE に入射したビームは回折広が



図3 DOE と BPF を用いた SF-STAMP の光学系セットアップ.
 (a)は DOE によって生成されるアレイビームが BPF に異なる角度で入射することにより透過帯域に変化が生じる原理を示す(参考文献[16]から許諾を得て転載).

り角αで広がる分岐ビーム(アレイビーム)になる.つま り、入射ビームは DOE により同じ特性をもったアレイ ビームに複製され、空間的に分解される.したがって、 DOE から発生するアレイビームの数が実現可能な連写枚 数に対応する.

次に、アレイビームは BPF により波長選択が行われる. 誘電体多層膜からなる BPF はビームの入射角 $\theta$  に依存して、(4.1)式のように透過波長 $\lambda(\theta)$  が変化する.(ただし、 $\lambda_0$ : BPF の中心波長、 $\theta$ :入射角、 $n_{\text{eff}}$ : BPF の基板の有効 屈折率である)

$$\lambda(\theta) = \lambda_0 \left( 1 - \frac{\theta^2}{2n_{\text{eff}}^2} \right) \tag{4.1}$$

この性質により図3に示すように誘電体多層膜から構成さ れるBPFを回転させ入射角 $\theta$ を変化させることで波長選択 が可能となる. さらに DOE から発生するアレイビームは 回折広がり角 $\alpha$ で伝搬していくので, $\theta$  傾いた BPF の両端 に入射するアレイビームの入射角はそれぞれ, $\theta+\alpha$ , $\theta-\alpha$ となる. これにより0次光 $\lambda(\theta)$ を中心に長波長 $\lambda(\theta-\alpha)$ , 短波長 $\lambda(\theta+\alpha)$ の帯域幅での波長選択が実現される. さら に DOE をビームの光軸を回転軸にして回転することでア レイビームも回転する. よって, DOEと BPFを組み合わせ ることで一枚の BFPにより $\lambda(\theta-\alpha)$ から $\lambda(\theta+\alpha)$ の波長の 範 囲内 $\Delta\lambda_{window} = \lambda(\theta-\alpha) - \lambda(\theta+\alpha)$ で異なる波長帯で 個々のアレイビームを分光できる.

#### 4.2.1 時間分解能

ここで SF-STAMP における時間分解能についてまとめ る. 図4に SF-STAMP の BPF で選択される波長幅と時間 幅の対応関係を示す. SF-STAMP の1ショットで得られ る全体の波長帯域幅(レーザーのスペクトル幅に対応)を  $\Delta\lambda_{window}$ , BPF でアレイビームの1つが波長選択されるス ペクトル幅を $\Delta\lambda_{BPF}$ (すべてのアレイビームに対して一定



図4 STAMP法における観測時間窓△T,各フレームの露光時間 t,フレーム間隔△tが決定される原理.各変数の説明は本文 を参照.この図では、BPFの異なる帯域を通過した中心波 長の異なる5つの時間遅延をもったパルスで表現している が、周波数チャープレートが小さくなると、パルス間隔が 狭まり時間的に重なり合い始める(参考文献[16]から許諾 を得て転載). Commentary

にはならない), 波長選択されたアレイビームの中心波長 差を $\Delta \lambda_{\text{DOE}}$ とすると, 計測時間窓 $\Delta T$  は, (4.2)式で表現さ れる. なお,  $\Delta \lambda_{\text{window}} = \lambda(\theta - \alpha) - \lambda(\theta + \alpha)$  である. ただし,  $\Delta \lambda_{\text{DOE}}$ も DOE と BPF の配置により変化するので必ずしも 等間隔ではないことに注意が必要である.

$$\Delta T = D \cdot z \cdot \Delta \lambda_{\text{window}} \tag{4.2}$$

ただし, D はレーザーパルスに二次分散量を与える際に用 いた媒質固有の分散パラメータ, z は分散媒質の長さであ る.したがって,計測時間窓は可変にできる.より広帯域 なレーザーパルスを用いると少ない分散量で時間窓を広く できるが, イメージング光学系における色収差の影響を補 正する必要がある.

各波長イメージの露光時間 $\tau$ は, (4.3)式で表現される [18].ここで, $\lambda_0$ は光パルスの中心波長,cは真空中にお ける光速である.

$$\tau = \sqrt{\left(\frac{2\lambda_0^2 \ln 2}{\pi c \varDelta \lambda_{\rm BPF}}\right)^2 + (D \cdot z \cdot \varDelta \lambda_{\rm BPF})^2}$$
(4.3)

(4.3)式の右辺ルート内の第一項は、スペクトル幅と時 間幅の関係を示す時間・周波数の双対性から決まる要素で ある.第二項は、周波数チャープパルスから狭い周波数帯 域を切り出すことで時間幅が狭くできることを示してい る.すなわち、BPFの帯域を狭くすることで第二項により 露光時間を狭めることが可能であるが、帯域を狭めすぎる と第一項の効果で逆に時間分解能は劣化してしまうことに なる.

フレーム間隔 *Δt* は,各波長間の遅延時間,すなわち波長 差 *Δλ*<sub>DOE</sub> で決定され(4.4)式のようになる.

$$\Delta t = D \cdot z \cdot \Delta \lambda_{\text{DOE}} \tag{4.4}$$

以上のように、分散量Dz、プローブ光全体の波長幅  $\Delta\lambda_{window}$ 、波長選択フィルタのスペクトル幅 $\Delta\lambda_{BPF}$ を適切に 設定することで時間分解能を設計可能である.

### 4.2.2 空間分解能

SF-STAMP の空間分解能は、使用するイメージセンサ の分解能およびイメージング光学系の分解能で決まる. 図3の SF-STAMP 光学系は 4 結像光学系がベースになっ ているため Object 面に像を転写することで、顕微光学系な ど他のイメージング法との組み合わせが可能である. Object 面への光学拡大率と Object レンズの倍率から、通常 の CCD カメラで数μmの顕微イメージングは容易に可能で ある.

#### 4.3 レンズアレイを用いた統合面内分光イメージング

SF-STAMPでは、ビームを複製してから波長選択を行 うという特性上、撮影枚数の増加とともに、照明光の光利 用効率が低下しイメージングのSNが低下するという課題 がある.そこで、光利用効率改善のため、マイクロレンズ アレイ(MLA)と回折格子を利用した統合面内分光法 [19,20]を応用し、高い光利用効率で画像情報の時空間分 解を実現する単一ショットバースト撮影法LA-STAMP (STAMP with Lens Array)を開発した[21].構築した セットアップを図5に示す、測定対象のイメージは、結像 レンズによって, MLA (60×60) 上に結像し, 各微小レン ズによって空間的にサンプリングされ、焦点面にアレイ状 のスポットを形成する. 各レンズから出射したビームは, コリメートレンズによって平行光となり,回折格子に異な る入射角度で入射する.回折格子によって波長分散を受け た各ビームは、結像レンズを通過し、スペクトル分解され たスポットがカメラ上の異なる場所にそれぞれ結像され る.このとき、回折格子による角度分散で隣り合うレンズ のスポットと空間的に重ならないように MLA を回転させ て調整する.撮像後,後処理として,欲しい波長帯の強度 のみを対応するカメラのピクセル信号から集め、60×60の マトリックス表示することで分光イメージを構築できる. 収集する帯域幅によって時間分解能、分光イメージ枚数は 決定される. 最小帯域幅はCCDカメラの1ピクセルサイズ あるいは、回折格子とレンズによるフーリエ変換によって 決まる単一波長成分のスポットサイズの大きい方で決ま る. もちろん, (4.3)式の時間・周波数の双対性から決ま る制限は同様に受ける.

図6は,波長帯毎に収集した分光イメージを6波長帯に ついて再構築した例である.計測ターゲットはUSAF-1951 テストターゲット(Newport 社製, RES-1)である.イメー ジは顕微光学系で50倍に拡大して取得した.テストター ゲットの構造から空間分解能は4.4 µm 以下と評価でき た.これは,光学的拡大率とMLAのピッチで決まる分解能 にほぼ一致する.



図5 マイクロレンズアレイと回折格子を用いた面内分光法をもちいた LA-STAMPの光学系セットアップ.(b)は、フーリエ面で分光スポットが重なり合わないようにマイクロレンズアレイを角度 a だけ回転させる必要性を示している.



図6 LA-STAMPで像再構成した際の空間分解能を確認するため に計測した六枚の中心波長の異なる分光イメージング.計 測対象は約4µm間隔のスリットアレイのチャート板であ る(参考文献[21]から許諾を得て転載).

#### 5. ナノ秒域への計測時間窓の拡張

サブピコ秒域の単一ショット超高速コマ撮り計測が注目 される一方で、一般的な高速フレームカメラでは計測でき ない数ナノ秒時間窓での単一ショット計測も、衝撃波、 レーザーアブレーション等のダイナミクスを観察するため には有効な手段である。STAMPの時間窓は二次分散量で スケーリング可能であるが、バルク石英等を透過させる方 法では現実的に数 10 ps が限界である。光ファイバーは原 理的に有効であるが、イメージングに使用できるような 数 10 μJ のフェムト秒パルスを透過させた場合、線形分散 以外に自己位相変調、誘導ラマン散乱、四波混合などの非 線形効果によるスペクトル変調が起き、扱いが難しくなる。

ナノ秒域時間窓での単一ショットバースト撮影を実現 するため構築した,中心波長が時間と共に掃引された パルス列を生成する FACED (Free-space Angular-Chirp-Enhanced Delay) 光学系を図7(a) に示す[22,23]. 波長毎 に異なる入射角で非平行ミラー対に入射した光は、多重反 射後に鉛直反射の条件を満たした波長のみが異なる遅延時 間をもって光路を戻り、再び回折格子によりコリメート ビームに近い空間特性で出射される. FACED を利用した 時間幅伸長では、入射光路と出射光路が一致するのは、入 射角がミラー対の角度ずれの整数倍である波長成分のみで あり、その他の波長成分では、完全には一致しない. FACED 出射後の伝搬方向は波長成分ごとに僅かに異なる ため、伝搬するにつれて空間的に分離するとともに、伝搬 経路の違いによる光路長の違いから、サンプル面において 時間的なずれが生じる.この FACED の特性によって生じ る,反射回数が同じ波長成分間での時間的なずれが,各パ ルスの実効的なパルス幅となり、シングルショット撮影に おける時間分解能となる. FACED から出射したパルスの 空間的にずれた成分をカットするため、回折格子から 200 mmの位置に開口4 mmのスリットを配置し、コリメー ト成分のみを切り出した. FACED 出射パルスのスペクト ルを図7(b)に示す[24]. この実験で用いた図7(a)の



図7 ナノ秒の観測時間窓を実現するために導入した FACED の 光学系セットアップ.(b)は4mm 幅の空間フィルタ後の 中心波長掃引パルス列のスペクトル.

FACED 光学系では、全反射鏡対の間隔 S が 45 mm、角度  $\alpha$  が 0.68 度であり、その結果、パルス間隔は約 300 ps でパ ルス幅は約 22 ps である。フレーム間隔は非平行鏡対の間 隔 S,パルス数は鏡の角度  $\alpha$  を変化させることで可変であ ることから、群遅延分散を用いたチャープ量の調整に変わ る手法として計測時間窓を広げるためには有効な手段であ る.

#### 6. 単一ショットバーストイメージング計測例

ここでは, STAMP, SF-STAMP, LA-STAMP を用いた 計測例をいくつか紹介する.

図8は、LiNbO<sub>3</sub>結晶にパルス幅70fs、中心波長800nm のフェムト秒レーザーパルス(40µJ)を線集光した際の Impulsive Stimulated Raman 過程によって発生したフォノ ン波の伝播を計測した例である[14].単一ショットで計測 しているのは6枚のフレームである。周波数チャープ量を 調整することで、フレーム間隔を切り変えて計測できるこ とがわかる。図の中段および下段のフレーム間隔が約 200fsの計測においては、(4.3)式の時間・周波数の双対 性により分光イメージされたフレームごとの時間パルスの 裾が隣接するフレームに被さっており、完全に時間的に分 離された分光イメージにはなっていないが、フォノン波の 伝播速度に対して時間分解能は十分であり、鮮明な像が得 られている。

図9は、SF-STAMPを用いて計測したフェムト秒レー ザーを厚さ約10nmのGe<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>Te<sub>5</sub>(GST)薄膜表面に点集 光した際に結晶からアモルファスに高速相変化する現象を 計測した例である[25].この計測では、プローブ光に



図8 初機 STAMP で計測した線集光フェムト秒レーザーパルス 励起フォノン波の伝播をフレーム数6枚で単ーショット バーストイメージ計測した例.周波数チャープレートを二 次分散量で変化させることでフレーム間隔を変化できるこ とを示した(参考文献[14]から許諾を得て転載).

#1	50 µm	#2		#3		#4		#5	
818 nm	0 fs	815 nm	246 fs	810 nm	656 fs	807 nm	902 fs	804 nm	1148 fs

図9 SF-STAMPを用いて計測したフェムト秒レーザーパルス誘 起GST薄膜の高速相変化. 図中の波長は各フレームを撮像 した光パルスの中心波長[24](参考文献[25]から許諾を得 て転載). Commentary

0.082 ps/nmの二次分散量を与え, 1.1 psの時間窓内で,平 均フレーム間隔 287 fs かつ平均露光時間 465 fs で計測を 行った.露光時間がフレーム間隔より大きいのは,これも 時間・周波数の双対性による制限である.実験結果より, 励起後約 250 fs 経過した辺り(2フレーム目)から透過率 が上昇し明るく映るアモルファスマークが観測された.こ れは先行研究で報告されている時間スケールに一致する結 果であり,シングルショットでの2次元イメージ計測とし ては現在のところ ST AMP 法のみが捉えることができる結 果である.

図10は,厚さ50 µmの薄膜ガラス(日本電気硝子社 製, Ultra Thin Glass[OA-10G]) 内部にフェムト秒レー ザーパルスを f=8 mm のレンズで側面から点集光させ,透 明材料の内部屈折率変化の超高速ダイナミクスのシングル ショット25枚バースト撮影を行った結果である[26]. ポン プ光のパルス幅は50 fs, 中心波長は800 nm, パルスエネル ギーは 30 μJ であった. プローブ光には 0.14 ps/nm の二次 分散量を与え、時間窓は5.6 ps, 平均フレーム間隔は 0.23 ps, 平均露光時間 0.52 ps であった. 7-9 フレームで は円形の屈折率変化が見え,輝度変化が徐々に大きくな る. それに伴い、細長い電離領域が成長していく様子がわ かる. 最後の25フレームでは、中央に黒いプラズマ領域と、 その上下に線状の屈折率変化が明瞭に浮かび上がってい る.このように、5.6 psの時間窓の間に励起パルスの集光点 付近にプラズマフィラメントが形成される様子が、シング ルパルスを用いた25フレームの超高速スナップショットと して観測された.この計測は、シャドーグラフ的な強度イ メージであるが、位相差顕微鏡のセットアップで位相変化 を強度イメージとして計測することも可能である.

図11は、プローブ光には 4FACED で生成した波長掃引 パルス列を用いた LA-STAMP での計測結果である. 薄膜 ガラス表面におけるアブレーション過程を 300 psのフレー ム間隔で 1.8 ns にわたってシングルショット撮影し[21]. 観測時間窓をナノ秒まで延ばすことで、アブレーションプ ルームの過渡状態がはじめて単一ショットバースト撮影で きた.



図10 SF-STAMPを用いて計測したフェムト秒レーザーパルスを 透明ガラス内部に集光した際の屈折率変化.図中の波長は 各フレームを撮像した光パルスの中心波長(参考文献[25] から許諾を得て転載).



図11 LA-STAMP に FACED で生成した中心波長掃引パルス列を 適用して計測した、フェムト秒レーザーパルスでガラス表 面をアブレーションさせた際の、単一ショットバーストイ メージ. 観測時間窓を 500 ps 以上に広げることでプループ の進展が観測できている(参考文献[21]から許諾を得て 転載).

STAMP法は,高速カメラと組み合わせることで,1kHz の繰り返しフェムト秒レーザー照射によるガラス加工のパ ルス積算加工において,各パルスでのアブレーション前駆 過程や加工進展中の変化をリアルタイムでバーストイメー ジ計測する応用も可能である[27].様々なレーザパルスパ ラメータや材料特性に対するレーザー加工性能の比較を容 易にするデータベースを短時間で取得できる.

#### 7. まとめ

瞬時周波数が時間と共に線形に変化した光パルスを用い 瞬時周波数を時刻と対応させることで、高速現象を能動的 にイメージ計測することを可能とするのが STAMP であ る.数10fsのレーザーパルスであれば材料分散を用いて線 形周波数チャープを与えることで 10 ps 程度までの計測時 間窓内で最短100 fs 程度の時間分解能での単一ショット バーストイメージングが可能となる.計測パラメータは二 次分散量で可変である.STAMP は様々な分光イメージン グ法を利用できるが、とくにSF-、LA-STAMP法はフレー ム数を容易に拡張できる.時間分解能をより向上させてさ らに超高速な過渡状態を計測することも挑戦的であるが、 一般的な高速カメラではまだカバーできないナノ秒領域ま で観測時間窓を拡張することも衝撃波伝播、レーザーパル ス加工等の観測には極めて有効である. 中心波長が時間掃 引されるパルス列を発生できる FACED は STAMP との組 み合わせにより, ナノ秒時間窓での単一ショットバースト イメージングが実現できる.

これまでのSTAMPは発光特性の計測には応用できてい ないが、和周波変換を利用することで可能となるであろ う.比較的簡便で高価なストリークカメラを必要としない 本手法が広く応用されることを期待したい.

#### 謝 辞

本論文に記載した研究は多くの方々の貢献によって実現 できたものですが、とくに中川桂一先生(東京大学),鈴木 敬和氏(現(株)資生堂),根本寛史氏((現)ベネッセコー ポレーション)の多大なる貢献に対して感謝いたします.

## 参考文献

- [1] H.P. Weber, J. Appl. Phys. 39, 6041 (1968).
- [2] E.P. Ippen and C. V. Shank, Appl. Phys. Lett. 27, 488 (1975).
- [3] M.A. Duguay and J. W. Hansen, Appl. Phys. Lett. 15, 192 (1969).
- [4] C.V. Shank and E. P. Ippen, Appl. Phys. Lett. 26, 62 (1975).
- [5] H. Mahr and M. D. Hirsch, Opt. Commun. 13, 96 (1975).
- [6] F. Mochizuki et al., Opt. Express 24, 4155 (2015).
- [7] H. Shiraga et al., Rev. Sci. Instrum. 66, 722 (1995).
- [8] M. Heya *et al.*, Rev. Sci. Instrum. **72**, 755 (2001).
- [9] 部谷 学 他:プラズマ・核融合学会誌 75,507 (1999).
- [10] J. Liang et al., Sci. Rep. 5, 15504 (2015).
- [11] P. Wang et al., Nat. Commun. 11, 2091 (2020).
- [12] K. Minoshima et al., Jpn. J. Appl. Phys. 33, L1348 (1994).
- [13] Z. Jiang and X.-C. Zhang, IEEE J. Quantum Electron. 36, 1214 (2000).



# かん なり ふみ ひこ 神成文 彦

慶應義塾大学理工学部電気情報工学科教 授.(社)レーザー学会副会長. 博士学生の時代にはレーザー核融合をめざ

して電子ビーム励起高出力気体レーザーの 研究をしていたので弱電離プラズマもかじっていましたが、 教員になってからはフェムト秒レーザーの広帯域性を利用し たコヒーレント光学,超高速フーリエ光学,プラズモンナノ 光学,量子シミュレーター開発,および新型レーザー開発の 研究に従事しています.博士教育リーディングプログラムの コーディネータとして、すでに10年間文理融合大学院教育を 学内横断的に進めています.

- [14] K. Nakagawa et al., Nat. Photonics 8, 695 (2014).
- [15] K. Hashimoto et al., Opt. Lett. 39, 6942 (2014).
- [16] T. Suzuki et al., Opt. Express 23, 30512 (2015).
- [17] P. Gabolde and R. Trebino, Opt. Express 14, 11460 (2006).
- [18] P.H. Lissberger, J. Opt. Soc. Am. 49, 121 (1959).
- [19] J.A.-Smith and R. Content, Publ. Astron. Soc. Pac. 110, 1216 (1998).
- [20] A. Boniface et al., Optica 6, 274 (2019).
- [21] H. Nemoto *et al.*, Opt. Lett. (*in press*).
- [22] J. Wu et al., Light Sci. Appl. 6, e16196 (2017).
- [23] Y. Xu and S. G. Murdoch, Opt. Lett. 44, 3697 (2019).
- [24] H. Nemoto *et al.*, Appl. Opt. **59**, 5210 (2020).
- [25] T. Suzuki et al., Appl. Phys. Express 10, 092502 (2017).
- [26] 鈴木敬和 他:レーザー研究 45,333 (2017).
- [27] T. Suzuki et al., Appl. Phys. A 126, 135 (2020).